

平成 28 年 9 月 26 日

集じん技術小委員会 WG-C 委員会  
委員・関係者各位

(一社) 日本粉体工業技術協会  
集じん技術小委員会 WG-C 委員会  
委員長 杉野 隆

平成 28 年度集じん技術小委員会  
第 3 回 WG-C 委員会開催のご案内

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、集じん技術小委員会においては、ろ過集じんの性能評価に関する国際標準化活動を行っております。つきましては平成 28 年度第 3 回 WG-C 委員会を下記次第にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、ご出席の上ご審議下さる様お願い申し上げます。

記

日 時 : 平成 28 年 10 月 18 日 (火) 15:00~17:00

会 場 : 種苗会館 6F 大会議室 (日本粉体工業技術協会東京事務所階上)  
東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館

担当: 澤野、下田 03-3815-3955

[o-sawano@appie.or.jp](mailto:o-sawano@appie.or.jp), [y-shimoda@appie.or.jp](mailto:y-shimoda@appie.or.jp)

- 議 題 : 1 ラウンドロビンテスト(実施方法・スケジュール等)  
2 その他

配布資料 1 当日配布

出席者 (順不同、敬称略)

金岡千嘉男、福井国博、井村俊明、上村富彦、岡安功史、奥山一博、木嶋敬昌、工藤 陽、栗原秀直、杉野 隆、森下あや子、大垣 豊(関係者)、明星敏彦(オブザーバー)

以上